



ZEISS XENOS 在其设计、材料的选择、驱动技术和传感器方面都处于世界技术的高水准。

ZEISS XENOS – 参考

XENOS可在各类要求高测量精度的领域使用——从科研机构的测量实验室、航空和航天工业直至光学工业。这一高端测量机的测量精度达到技术极限，其测量范围近1立方米。创新的驱动技术和碳化硅陶瓷材料的使用也确保了机器绝佳的动态性能。

测量范围 [mm]

X	Y	Z
900	1,500	700

创新的机械设计

ZEISS XENOS新型的机械设计基于经过验证的ZEISS CenterMax, 令人印象深刻。与标准桥式测量机不同: Y导轨分布于侧壁顶部, 分离式移动行程轴仅横梁于Y轴方向移动, 更小及恒定的移动重量——与移动式平台相比堪称真正的优势。更低及恒定的移动重量造就了加速及最高速度的完美统一。

所有轴均采用线性驱动

XENOS的所有轴均采用线性驱动。其优点: 高速、加速极快、定位精度高、驱动无剪切力影响结合超高分辨率光栅尺技术, XENOS的线性驱动可获得高度稳定性及低于结合超高分辨率光栅尺技术, XENOS的线性驱动可获得高度稳定性及低于100纳米的极高定位精度。例如, 测针偏移量越恒定, 即可获得更佳的测量精度。于测量曲面时更显见另一优势: 测针的移动路径与预定值越吻合, 即可实现越出色的精确性。



Y轴上直线同步驱动过程中的动态重量分布得到全盘充分考虑

虚拟中央驱动

于测量曲面时更显见另一优势：测针的移动路径与预定值越吻合，即可实现越出色的精确性。虚拟中央驱动XENOS于Y轴向配备双线性驱动系统，得益于蔡司最新的中央驱动技术可实现优异的同步控制。该技术可据X轴位置完美分布驱动力作为最新控制系统及算法之完美结合，这是在整个测量范围内获得优异的测量精度及运动稳定性的关键因素。

碳化硅陶瓷

XENOS于Y轴向配备双线性驱动系统，得益于蔡司最新的中央驱动技术可实现优异的同步控制。该技术可据X轴位置完美分布驱动力作为最新控制系统及算法之完美结合，这是在整个测量范围内获得优异的测量精度及运动稳定性的关键因素。碳化硅陶瓷XENOS在与精度密切相关的机器部件上采用创新的碳化硅陶瓷材料。迄今为止，该材料从未在类似产品或精度的测量机器上得到使用与常规陶瓷相比，碳化硅陶瓷的热膨胀性降低约50%，而刚性则可最大提升30%，同时减重20%。



ZEISS

XENOS

加强型VAST gold

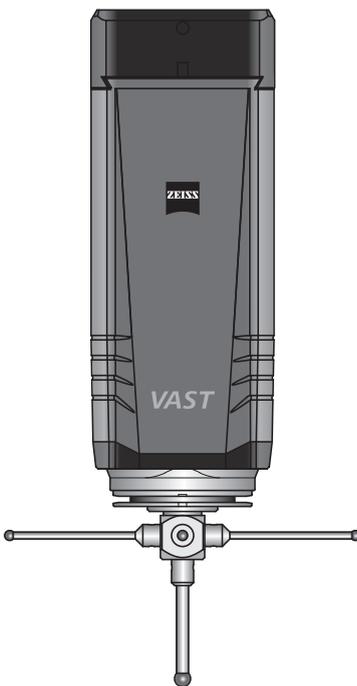
XENOS采用ZEISS VAST gold测量探头。在研发过程中, 蔡司在测量精度和测量重复度方面对该探头进行了优化。XENOS也采用了新型刚性连接。VAST gold探头可与最大长度为800毫米的测针以及最大重量为500克的测针配套使用, 包括非对称型测针。

改进的电子设计

通过全新的电子设计, 移动线缆对精度影响显著降低。计算机辅助精度修正 (C-AA) 法和特殊附加CAA修正技术在获得最大测量精度的过程中扮演着日趋重要的作用。

优化的气浮轴承

全新强化处理气浮轴承具有优异的稳定性及测量精度。



ZEISS XENOS

测量范围 X x Y x Z [mm]

900 x 1,500 x 700

